

# 带鲁尔接头和密封盖的高纯Ptfе耐腐痕量分析反应釜

货号: PL-CP7369



## 简介

集成鲁尔接头与密封盖的高纯聚四氟乙烯反应釜，具备极致耐腐蚀性与零浸出特性。这些可定制反应罐为要求严苛实验室中的痕量分析、强腐蚀性化学合成与精密流体传输提供可靠超洁净环境。

## 了解更多

应用场景	说明	核心优势
痕量金属分析	ICP-MS与ICP-OES分析的样品制备与储存，需完全避免增塑剂浸出。	零金属污染
半导体加工	储存与反应高纯度蚀刻化学品，如氢氟酸与硝酸混合液。	长期材料稳定性
药物合成	活性药物成分（API）小规模合成，对环境纯度要求高。	无反应接触表面
电池研究	在受控条件下测试腐蚀性电解液与锂电池组件。	耐盐腐蚀
水热消解	加压环境下对地质或环境样品进行高温消解。	耐热耐压
标准溶液配制	配制与长期储存一级分析标准品与参考物质。	长期使用浸出极低
挥发性有机物采样	通过鲁尔接口进行封闭体系采样，防止分析过程中挥发性化合物损失。	安全无泄漏流路
生物医学研究	用于蛋白质合成或脂质提取的反应容器，要求良好生物相容性。	生物惰性界面

参数	PL-CP7369-50	PL-CP7369-100	PL-CP7369-CUST
标称容积	50ml	100ml	支持定制容积
材质	高纯聚四氟乙烯	高纯聚四氟乙烯	高纯聚四氟乙烯
接头类型	集成鲁尔锁/锥度接头	集成鲁尔锁/锥度接头	按客户要求定制
密封盖设计	螺纹配密封圈	螺纹配密封圈	可定制多接口
温度范围	-200°C 至 +260°C	-200°C 至 +260°C	依应用场景确定
化学兼容性	全兼容（熔融碱除外）	全兼容（熔融碱除外）	全兼容
制造工艺	精密CNC加工	精密CNC加工	定制CNC制造
表面光洁度	超光滑/无孔隙	超光滑/无孔隙	可控Ra表面光洁度
浸出特性	无 detectable 离子/可浸出物	无 detectable 离子/可浸出物	可提供纯度等级认证